# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-240555

(43) Date of publication of application: 17.09.1996

(51)Int.CI.

C12Q 1/00 GO1N 21/66 G01N 25/48 G01N 27/414

G01N 27/72

(21)Application number : 07-042211

(71)Applicant: KOBE STEEL LTD

(22)Date of filing:

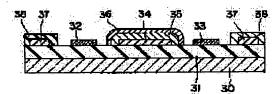
01.03.1995

(72)Inventor: KOBASHI KOJI

# (54) DIAMOND THIN-FILM BIOSENSOR

## (57)Abstract:

PURPOSE: To increase sensitivity, extend life, and achieve high-speed response and reutilization possibility by constituting one portion or entire portion of a transducer with semiconductor diamond film or undoped diamond film and fixing an organism-related identification substance to one portion or entire portion of the surface. CONSTITUTION: An undoped diamond film 31 is formed as a ground film on a substrate 30 and an operation electrode 34, a counter electrode 33, and a reference electrode 32 are formed on the film 31. The electrode 34 is covered with an organism-related identification substance 35 and further the identification substance 35 is covered with an organism film 36. The electrode 34, the electrode 35, and the electrode 32 are surrounded by a semiconductor diamond heater 37. The heater 37 is covered with an undoped diamond film 38, thus fully utilizing such features as the organism-conforming property and inactivity and harmlessness for a chemical reagent which a diamond has.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

19.09.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3566377

[Date of registration]

18.06.2004

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

This Page Blank (uspio)

FD .	_	extinction		:	أعاسا	٦
Date	OT	extinction	ОΤ	n	gnt	J

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

This Page Blank (uspio)

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平8-240555

(43)公開日 平成8年(1996)9月17日

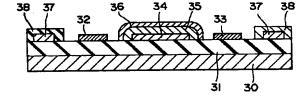
GO 1 N 27/327   GO 1 N 27/30   3 5 3 Q     C 1 2 Q 1/00   6807-4B   C 1 2 Q 1/00   B     GO 1 N 21/66   GO 1 N 21/66   25/48   27/72     客査請求 未請求 請求項の数19 OL (全 17 頁) 最終日本	1/00 B 1/66 5/48 7/72 iの数19 OL (全 17 頁) 最終頁に続く
C1 2 Q 1/00	1/00 B 1/66 5/48 7/72 iの数19 OL (全 17 頁) 最終頁に続く
C1 2 Q 1700 G0 1 N 21/66 G0 1 N 21/66 25/48 25/48 27/414 客査請求 未請求 請求項の数19 OL (全 17 頁) 最終1 (21)出願番号 特顧平7-42211 (71)出願人 000001199 株式会社神戸製鋼所 兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3 (72)発明者 小橋 宏司 兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5名	1/66 5/48 7/72 (の数19 OL (全 17 頁) 最終頁に続く
25/48   25/48   27/72	5/48 7/72 (の数19 OL (全 17 頁) 最終頁に続く
27/414	7/72 1の数19 OL (全 17 頁) 最終頁に続く
審査請求 未請求 請求項の数19 OL (全 17 頁) 最終]   (21)出願番号 特顧平7-42211	で Manage OL (全 17 頁) 最終頁に続く
審査請求 未請求 請求項の数19 OL (全 17 頁) 最終日	
(22)出顧日 平成7年(1995) 3月1日	000001199
(22)出顧日       平成7年(1995) 3月1日       兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3         (72)発明者       小橋 宏司         兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5名	
(72)発明者 小橋 宏司 兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5名	株式会社神戸製鋼所
兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5名	兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号
	小橋 宏司
株式会計補戶製圖所神戸総合技術	兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番5号
MANUAL TELEVISION OF SECULAR	株式会社神戸製鋼所神戸総合技術研究所内
(74)代理人 弁理士 藤巻 正憲	弁理士 藤巻 正憲

# (54) 【発明の名称】 ダイヤモンド轉膜パイオセンサ

# (57)【要約】

[目的] 化学物質及び生体物質を、高感度及び高速応 答性で検出でき、再利用可能である長寿命のダイヤモン ド薄膜バイオセンサを提供する。

【構成】 トランスデューサの一部又は全部が半導体ダイヤモンド膜又はアンドープダイヤモンド膜から構成され、その表面の一部又は全部に生体関連識別物質が固定されている。その周辺回路の一部又は全部がアンドープダイヤモンド膜又は半導体ダイヤモンド膜により構成されている。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 トランスデューサの一部又は全部が半導 体ダイヤモンド膜又はアンドープダイヤモンド膜から構 成され、その表面の一部又は全部に生体関連識別物質が 固定されていることを特徴とするダイヤモンド薄膜バイ オセンサ。

【請求項2】 その周辺回路の一部又は全部がアンドー プダイヤモンド膜又は半導体ダイヤモンド膜により構成 されていることを特徴とする請求項1 に記載のダイヤモ ンド薄膜バイオセンサ。

【請求項3】 前記トランスデューサがダイオード型で あって、作用電極、対向電極及び参照電極のうち少なく とも作用電極が、生体関連識別物質が固定された半導体 ダイヤモンド膜で構成されていることを特徴とする請求 項1 に記載のダイヤモンド薄膜バイオセンサ。

【請求項4】 前記トランスデューサがマイクロアレイ 型であって、作用電極と対向電極との間に、生体関連識 別物質が固定されたアンドーブダイヤモンド膜が配置さ れていることを特徴とする請求項1に記載のダイヤモン ド薄膜バイオセンサ。

【請求項5】 前記トランスデューサがトランジスタ型 であって、そのトランジスタ部の一部又は全部が半導体 ダイヤモンド膜により構成され、そのゲート部及び/又 はその他の領域に生体関連識別物質が固定されていると とを特徴とする請求項1に記載のダイヤモンド薄膜バイ オセンサ。

【請求項6】 前記トランスデューサがサーミスタ型で あって、その温度感応部の一部又は全部が半導体ダイヤ モンド膜により構成されていることを特徴とする請求項 1 に記載のダイヤモンド薄膜バイオセンサ。

【請求項7】 前記トランスデューサがホール効果型又 は磁気抵抗型であって、その磁気感応部の一部又は全部 が半導体ダイヤモンド膜により構成されていることを特 徴とする請求項1 に記載のダイヤモンド薄膜バイオセン

【請求項8】 前記トランスデューサが光センサ型であ って、その発光部及び/又は受光部の一部又は全部が半 導体ダイヤモンド膜により構成されていることを特徴と する請求項1 に記載のダイヤモンド薄膜バイオセンサ。 【請求項9】 その基板がアンドープ又は半導体のダイ 40

ヤモンド膜又は自立性のダイヤモンド膜により構成され ていることを特徴とする請求項1に記載のダイヤモンド 薄膜バイオセンサ。

【請求項10】 前記生体関連識別物質の固定に先立 ち、前記アンドーブダイヤモンド膜又は半導体ダイヤモ ンド膜の表面が水素化、酸化又はハロゲン化されている か、水酸基、シアノ基、アミノ基、カルボキシル基、硫 酸基及びニトロ基からなる群から選択された1又は2以 上の置換基で化学修飾されていることを特徴とする請求 項1乃至9のいずれか1項に記載のダイヤモンド薄膜バ 50 ドービングすることにより、半導体化することができ

イオセンサ。

【請求項11】 更に、機能性分子を化学結合させ、し かる後に生体関連識別物質が固定されていることを特徴 とする請求項10に記載のダイヤモンド薄膜バイオセン サ。

2

【請求項12】 前記機能性分子が水酸基、シアノ基、 アミノ基、カルボキシル基、硫酸基及びニトロ基からな る群から選択された1又は2以上の置換基を含むことを 特徴とする請求項11に記載のダイヤモンド薄膜バイオ 10 センサ。

【請求項13】 前記機能性分子がヘキサメチレンジア ミン又はヘキサメチレンジアミンの誘導体であることを 特徴とする請求項11又は12に記載のダイヤモンド薄 膜バイオセンサ。

【請求項14】 前記機能性分子がフェロセン、キノン 又はこれらの誘導体であることを特徴とする請求項11 又は12に記載のダイヤモンド薄膜バイオセンサ。

【請求項15】 前記生体関連識別物質の表面にモノレ イヤー以上の生体膜がコーティングされていることを特 20 徴とする請求項1乃至14のいずれか1項に記載のダイ ヤモンド薄膜バイオセンサ。

【請求項16】 前記アンドープダイヤモンド膜又は半 導体ダイヤモンド膜は、天然ダイヤモンド又は人工合成 のダイヤモンド結晶を基板としてその上に気相合成によ り形成されたものであることを特徴とする請求項1 に記 載のダイヤモンド薄膜バイオセンサ。

【請求項17】 前記アンドーブダイヤモンド膜又は半 導体ダイヤモンド膜は一層又は多層に積層されていると とを特徴とする請求項1に記載のダイヤモンド薄膜バイ 30 オセンサ。

【請求項18】 前記アンドーブダイヤモンド膜又は半 導体ダイヤモンド膜は、多結晶膜、高配向膜又はヘテロ エピタキシャル膜であることを特徴とする請求項1 に記 載のダイヤモンド薄膜バイオセンサ。

【請求項19】 前記ダイヤモンド膜は、その表面の一 部又は全部が(111)結晶面又は(100)結晶面か ら構成されているととを特徴とする請求項1乃至18の いずれか1項に記載のダイヤモンド薄膜バイオセンサ。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は医療、食品管理、工業プ ロセス又は環境モニタなどに利用されるバイオセンサ又 は化学センサとして好適のダイヤモンド薄膜バイオセン サに関する。

[0002]

【従来の技術及び解決すべき問題点】ダイヤモンドは耐 熱性が優れ、バンドギャップが大きい(5.5eV)と とが特徴である。とのため、アンドープダイヤモンド膜 は電気的に絶縁体であるが、ボロン(B)等の不純物を

る。また、ダイヤモンドは絶縁破壊電圧及び飽和ドリフト速度か大きく、更に誘電率が小さいという優れた電気的特性を有する。

【0003】このような性質を利用して、半導体ダイヤモンドを用いた温度センサ、整流ダイオード、電界効果トランジスタ等の電子デバイスの開発が進められている。また、ダイヤモンドのバンドギャップが大きいことを利用して、紫外線等の短波長領域に対応する光センサ又は発光素子への応用についての研究も行われている。【0004】このような電気的特性に加え、ダイヤモンドは熱伝導率が大きい点、比熱が小さい点、化学試薬に対して安定である点、耐熱性が優れている点、放射線照射によるダメージが少ない点等で、他の物質を大きく凌ぐ特徴を有している。

【0005】ダイヤモンドがこのように優れた複合的な特性をもっているにも拘わらず、半導体分野では、従来、ダイヤモンドの耐熱性に注目した高温用デバイス(温度センサ、ダイオード、トランジスタ等)の研究以外の研究は希である。

【0006】さて、近年、特定の化学物質・生体物質と特異的に反応する酵素、抗原、抗体、オルガネラ、動植物細胞、結合性蛋白質、微生物などの生体関連識別物質(以下これを単に「識別物質」と略称する)を電極に固定し、その反応による物理的・化学的変化を電気信号として検出するバイオセンサが研究されている。バイオセンサの概念を図21に示す。

[0007] バイオセンサの中で広範に用いられているのはグルコース・センサである。これは酸素検出用電極又は過酸化水素検出用電極と、電極に固定されたグルコースオキシダーゼとから構成されている。試料中のグルコースがグルコースオキシダーゼと触媒反応してグルコノラクトンに変化するときに消費される酸素の減少量又は発生する過酸化水素の濃度を電極で検出してグルコース濃度を測定する。この場合には、グルコースオキシダーゼが識別物質である。

【0008】本願発明者はダイヤモンドが生体適合性に優れ、しかも半導体化及び微細加工が可能であることに注目し、広範なバイオセンサのトランスデューサ(信号変換回路)及びその周辺回路に応用できる点に着目した。ダイヤモンドは炭素原子が共有結合された物質であり、識別物質に対して無害であるばかりでなく、識別物質との親和性がよい。更に、ダイヤモンド表面は化学修飾により親水性から疎水性まで制御できるので、抗血栓性をもたせることもできる。

【0009】しかしながら、ダイヤモンドの生体適合性については、従来、人工臓器の部品のコーティング程度の応用しか考えられておらず、ダイヤモンドの半導体特性と生体適合性との双方の特徴を同時に利用した応用例は全くみられない。

【0010】例えば、文献「(1)X.Zhang et al, Procee 50

dings of the 2nd International Conference on the A pplications of Diamond Films and Related Material s, edited by M. Yashikawa et al (MYU, Tokyo 1993), p.65; (2)X. Zhang et al, Materials Letters, Vol.1 8,pp.318-319(1944); (3)J.Zhu et al, Biosensors & Bioelectronics, Vol.9, pp.295-300(1994)」(以下、これを従来技術1という)では、非ダイヤモンド材料の上にダイヤモンド薄膜をコーティングし、これをグルコース・センサの基板として用いている。

[0011] しかし、従来技術1においては、ダイヤモンド薄膜はその上に密着性よく金属電極を形成するだけの目的に用いられており、ダイヤモンド以外の材料でも十分に代替できる。また、従米技術1ではダイヤモンド薄膜は試料と接触することはなく、ダイヤモンドのもつ生体適合性の特徴が全く利用されていない。

【0012】ダイヤモンドを化学電極として用いる試みは文献「(1)K.Patel et al,平成3年度、日本太陽エネルギー学会・日本風力エネルギ協会合同研究発表講演論文集(1991年9月20日、21日) pp.105-108;

(2)K.Patel et al, J.Photohem.Photobil.A:Chem., Vol. 65,pp.419-429(1992); (3)R.Tenne et al, J.Electro anal.Chem.Vol.347,pp.409-415(1993); (4)S.Yang et al, Advances in New Diamond Science and Technology, edited by Y.Saito et al (MYU,Tokyo 1994),pp.741-744] (以下、これを従来技術2という) に示されており、半導体ダイヤモンドを電極に用いることにより、還元反応を効率よく進めることができることが見出されている。

[0013] しかし、従来技術2においては、ダイヤモンド電極の化学工業分野への応用を目的としているので、バイオセンサへの応用及びセンサ製作に必要な微細加工などについては全く触れられていない。

【0014】特開昭61-33645(以下、これを従来技術3という)においては、図22に示すように、ダイヤモンド膜又はダイヤモンド状非晶質炭素膜を、公知のシリコン半導体を用いて作製されたイオン感応電界効果型トランジスタ(Ion Sensitive Field Effect Transistor、以下、これをISFETと略称する)のゲート部の絶縁膜として用いる方法が示されている。即ち、p型シリコン基板6の表面に、n型シリコン拡散層からなるソース4及びドレイン5が形成されており、この基板上には、第1の絶縁層1と、その上のダイヤモンド膜又はダイヤモンド状非晶質炭素膜2とが積層されていて、これによりゲート絶縁膜3が構成されている。

【0015】しかし、品質の良いダイヤモンド薄膜をコーティングする場合には、基板温度を約800℃にする必要があるが、このような高温下ではシリコン半導体を用いたISFETは熱破壊されてしまう。そこで、従来技術3は実際には適用不可能である。

【0016】パイオセンサの長寿命化には、繰り返し測

定又は長時間測定に対して識別物質の流出を防ぐことが 必要である。識別物質を固定する方法としては以下の技 術が開示されている。即ち、特開昭60-29657 号、特開昭60-39547号、特開昭60-7925 8号には、半導体微細加工用のフォトリソグラフィー・ プロセスで用いられる感光樹脂(フォトレジスト)と識 別物質を混合してISFETのイオン感応面に塗布し、 光硬化させる方法が開示されている。また、特開昭60 -247151号においては、識別物質に親和性がある 有機膜をISFETのゲート部表面に塗布し、識別物質 10 を固定する方法が開示されている。更に、特開昭63-229358号では、上記処理の後、更にその表面を不 溶化する方法が開示されている。以下、これらの技術を 従来技術4とする。

【0017】しかし、上述のような生体関連物質の固定 方法においては、識別物質を感光樹脂と混合するので使 用可能な感光樹脂の種類に制限があり、また混合により 生体関連物質の活性を弱めてしまうという問題点があ る。また、リソグラフィーにおいて、紫外光照射又は現 像液若しくは剥離液等で処理される過程でも、識別物質 20 の活性が低下する。更に、化学物質及び生体物質が感光 樹脂膜の内部を拡散し、また反応により生成した副生成 物質が感光樹脂膜の外部に拡散することも必要である。 しかしながら、一般に化学物質及び生体物質の拡散速度 は遅いので、このようなバイオセンサの応答速度は極め て遅く、バイオセンサからの電気信号の強度が安定する までに長時間が必要であるという問題点がある。

【0018】一方、識別物質の流出を防止する技術とし て、以下の技術が開示されている。即ち、特開昭60-173459では、識別物質を塗布した後、多孔体で被 30 覆するととが開示されている。また、特開昭61-88 135、特開昭61-234349では架橋反応により 識別物質分子間を化学結合させて流出を防ぐ方法が開示 されている。しかしながら、これらの場合にも上記と同 じ問題点がある。

【0019】また、バイオセンサの構造としては、以下 のものが公知である。

(1) 図23に示すように、平面基板7上に測定用の作 用電極9及び対向電極8の2電極が形成されており、更 に参照電極10を備えている。そして、作用電極9の上 40 には、生体関連識別物質11がコーティングされ、中央 部に、絶縁樹脂12が被覆されている(特開昭60-1 73459:以下、これをダイオード型という)。

(2)図24に示すように、ダイオード型で電極がマイ クロアレイであるタイプ (従来技術4、例えば特開昭6 0-247151:以下、これをマイクロアレイ型とい う)がある。シリコン基板13上に、シリコン酸化膜1 4が形成されており、このシリコン酸化膜14の上に、 素子分離用のシリコン酸化膜15が局所的に形成されて いる。そして、とのシリコン酸化膜15に囲まれた領域 50 揃った高配向膜の合成も報告されている。

に、クロロメチル化ポリスチレン膜16を間に挟んで作 用電極17及び対向電極18がアレイ状に形成され、ク ロロメチル化ポリスチレン膜の上に、酵素19が固定さ れている。

(3) 図25に示すように、ISFETのゲート部位に 識別物質を固定し、イオン又はpHの変化に応答させる タイプがある(特開平5-281181:以下、とれを トランジスタ型という)。即ち、サファイア基板20の 裏面に、金膜21が形成され、サファイア基板20の表 面に、npn構造のFET26が設けられている。そし て、これらのFET26を被覆するようにして、酸化シ リコン膜22、窒化シリコン膜23が形成されており、 その上に、アルブミン24及びグルコースオキシダーゼ 25が固定されている。

(4) 図26はサーミスタ回路27の上に、生体関連識 別物質28が固定されているものである。この図26に 示すものは、固定化した識別物質が反応するときの反応 熱発生による温度上昇を感知するタイプである(特開6 1-212750:以下、とれをサーミス夕型とい う)。

(5)また、図27に示すように、特開平5-2568 12には、図23と同様のダイオード型のバイオセンサ 基板7の上に、対向電極8、作用電極9及び参照電極1 0を形成し、作用電極9に生体関連識別物質11を固定 し、これらの周囲に、更に温度調節用ヒータ29を組み 込んだバイオセンサが開示されている。

【0020】しかしながら、図23~図27に開示され たバイオセンサでは電極として金属を用いているために 識別物質の固定が困難であり、使用中に識別物質の流出 が著しいために寿命が短いという問題がある。また図2 5のISFETではゲート部の絶縁膜が酸化シリコン (セラミックス) であり、上記と同じく識別物質の固定 が困難であるという問題がある。

【0021】これに対しダイヤモンドは識別物質と同じ く炭素を構成原子としているために、識別物質との適合 性が良く、さらにダイヤモンド膜表面を化学修飾すると とにより、識別物質との親和性を向上できるため、その 固定が容易であるという特徴がある。

【0022】ダイヤモンドの気相合成法としては、マイ クロ波化学気相蒸着 (CVD)法(例えば特公昭59-27754、特公昭61-3320)、高周波プラズマ CVD法、熱フィラメントCVD法、直流プラズマCV D法、プラズマジェット法、燃焼法及び熱CVD法等が 知られている。

【0023】これらの方法でシリコンなどの非ダイヤモ ンド基板に気相合成されたダイヤモンド膜は、一般にダ イヤモンド粒子がランダムに凝集した多結晶であり、粒 界が高密度に存在する。しかし、最近では、特殊な基板 表面処理によりダイヤモンド結晶粒子がほぼ一定方向に

【0024】ダイヤモンド膜の表面を(111)結晶面 又は(100)結晶面のみから構成することは、多結晶 ダイヤモンド膜でも高配向膜でも可能である。

【0025】パルクダイヤモンド上にダイヤモンド膜を 形成する場合は、バルクダイヤモンドを特定の結晶面に 沿って切断・研磨することにより、任意の結晶面をもっ たダイヤモンド膜を得ることができる。

【0026】ダイヤモンド合成原料に微量の不純物を添 加することにより、ダイヤモンドを半導体化することが できる。例えば高温高圧合成でも、気相合成でも、不純 10 物としてホウ素 (B) を添加すると導電性の良い p型の 半導体ダイヤモンドが得られることが知られている。

[0027] 本発明はかかる問題点に鑑みてなされたも のであって、髙感度・長寿命・髙速応答性・再利用可能 の全ての要望を満足することができるダイヤモンド薄膜 バイオセンサを提供することを目的とする。

#### [0028]

【課題を解決するための手段】本発明に係るダイヤモン ド薄膜バイオセンサは、トランスデューサの一部又は全 部が半導体ダイヤモンド膜又はアンドープダイヤモンド 膜から構成され、その表面の一部又は全部に生体関連識 別物質が固定されていることを特徴とする。

### [0029]

【作用】本発明においては、半導体ダイヤモンド膜を用 いてトランスデューサを作製し、これに識別物質を固定 しているので、極めて高感度・長寿命・高速応答性であ り、再利用可能なバイオセンサを得ることができる。

【0030】バイオセンサのトランスデューサの一部又 は全部をダイヤモンド膜で製作することにより、ダイヤ モンドのもつ生体適合性を有効に利用することができ る。

【0031】なお、一旦、特性か劣化したダイヤモンド 薄膜バイオセンサであっても、その生体関連識別物質又 は生体関連識別物質及び機能性分子を化学処理により除 去し、再び生体関連識別物質の固定又は機能性分子の結 合と生体関連識別物質の固定により、再生することが可 能である。

【0032】本発明においては、半導体ダイヤモンド膜 又はアンドープダイヤモンド膜を用いてトランスデュー サを作製し、これに識別物質を固定することにより、ダ 40 イヤモンドのもつ生体適合性、化学試薬に対する不活性 性、無毒などの特徴を生かすことができる。

【0033】また、ダイヤモンドの表面処理により親水 性から疎水性までを制御できるので、ダイヤモンド・セ ンサに抗血栓性をもたせることもできる。

【0034】本発明においては、さらにバイオセンサ を、ダイオード型、トランジスタ型、サーミスタ型、又 は磁気センサ型に構成することができ、これらの複数の センサを同一基板に形成することもできる。

とにより感度を増大させることができる。

[0036]

【実施例】以下、本発明について添付の図面を参照して 詳細に説明する。図1はダイヤモンド薄膜を用いたダイ オード型センサのトランスデューサ部の断面構造の例を 示す。ダイヤモンド膜の微細加工は「選択成長」及びプ ラズマ・エッチング又は機械加工等の公知の技術により 行うことができる。例えば、トランスデューサの作製に 必要なダイヤモンドの微細加工技術又は選択成長技術

は、文献T.Inoue et al.,J.Appl Phys.、Vol.67,No.12,p p.7329-7336(1990)に示されている。

【0037】トランスデューサを加熱するヒータ、試料 の温度を測定する温度センサなどの周辺回路も半導体ダ イヤモンド膜を用いて作製できる。このトランスデュー サと周辺回路をモノリシックに作製した場合は、機能面 及びコスト面からもメリットが大きい。

【0038】図1に示すように、基板30の上に、下地 膜としてアンドープダイヤモンド膜31が形成されてお り、このアンドーブダイヤモンド膜31の上に、作用電 20 極34、対向電極33及び参照電極32が形成されてお り、作用電極34は生体関連識別物質35により被覆さ れており、更にこの生体関連識別物質35は生体膜36 により被覆されている。

【0039】これらの作用電極34、対向電極33及び 参照電極32は、半導体ダイヤモンドヒータ37により 取り囲まれており、このヒータ37はアンドープダイヤ モンド膜38により被覆されている。

【0040】図1では下地を電気絶縁性のアンドープダ イヤモンド膜31としたが、下地のない構造にすること も可能である。これは以下のいずれの場合にも同様であ 30

【0041】電極、下地膜及びヒータに半導体ダイヤモ ンド膜を用いる場合、そのサイズに特別の制限はなく、 ドーピング濃度によって最適値を選ぶことができるが、 特性及びコスト等を考慮すると、アンドープダイヤモン ド下地層31の厚さは1~50μm、電極32~34の 厚さは0.1~5 µm、電極32~34のアクティブな 領域の長さ及び幅は20μm~1mm、ヒータ37の厚 さは0.1~50μm、電気絶縁のためのアンドープダ イヤモンド膜38の厚さは0.5~10μmの範囲が最 も望ましい。

【0042】図2乃至図5は夫々マイクロアレイ型セン サのトランスデューサ部の断面構造を示す。図2に示す ように、基板40の上に、下地膜としてアンドープダイ ヤモンド膜41が形成されており、この下地膜41の上 に、複数個の対向電極43と作用電極44とが、間にア ンドープダイヤモンド膜47を挟んで配列されている。 また、最外側の対向電極43の外側にもアンドープダイ ヤモンド膜47が設けられている。そして、このアンド 【0035】また、トランスデューサ部に光照射すると 50 ーブダイヤモンド膜47の上に、生体関連識別物質45

40

10

が固定されており、この生体関連識別物質45は生体膜 46により被覆されている。更に、アンドーブダイヤモ ンド膜41の上には、参照電極42が形成されている。 【0043】との図2のように、作用電極44と対向電 極43の間をアンドープダイヤモンド膜47とし、これ に識別物質45を固定する他、下地としてアンドープダ イヤモンド膜41を用いた場合には、図3に示すよう に、作用電極44と対向電極43との間のアンドープダ イヤモンド膜47は必ずしも必要ではなく、省略でき の表面に、直接、識別物質45を固定すればよい。

【0044】また、ダイオード型と同じように作用電 極、対向電極、参照電極のいずれか又は全てを半導体ダ イヤモンド膜とすることができる。図4及び図5に示す ように、ダイオード型と同様に、少なくとも作用電極4 4として半導体ダイヤモンド膜を用い、この半導体ダイ ヤモンド膜44の表面に識別物質45を固定することも

【0045】マイクロアレイ型センサについても、ダイ オード型センサと同じく、電極、下地及びそのサイズに 20 特別の制限はなく、ドービング濃度も最適値を選ぶこと ができる。アクティブなダイヤモンド膜電極の幅は1~ 20μm、長さは20μm~lmmの範囲が最も望まし 64

【0046】トランスデューサがトランジスタ型の場 合、そのトランジスタ部を半導体ダイヤモンド膜を用い て作製することができる。図6乃至図9はそのトランジ スタ型のダイヤモンドセンサの例を示す。図6は、トラ ンジスタがMESFET (Metal-Semiconducor FET) の 場合である。

【0047】基板50の上に、アンドープダイヤモンド 膜52及びゲート電極51が形成されており、このアン ドープダイヤモンド膜52の上に、半導体ダイヤモンド 膜53が形成されている。この半導体ダイヤモンド膜5 3の表面には、2個のp\*ダイヤモンド層54が形成さ れており、これらのp\*ダイヤモンド層54の上には、 ソース電極55a及びドレイン電極55bが形成されて いる。p\*ダイヤモンド層54(以下、これをp\*層と略 称する)は、イオン注入又は気相合成によりBを高濃度 (10<sup>1</sup> ~ 10<sup>1</sup> / c m³) にドーピングしたものであ る。

【0048】そして、ソース電極55a及びドレイン電 極55bは酸化シリコン、窒化シリコン、樹脂等の絶縁 材料又はこれらを積層した電気絶縁膜56で覆われてい る。ソース電極55a及びドレイン電極55bの直下の p\*層54により、電極55a、55bと半導体ダイヤ モンド層53との間の接触抵抗を低減できる。

【0049】生体関連識別物質57はソース・ドレイン 電極の間(以下、とれをゲート部と略称する)に固定さ れ、安定化のためにその表面が生体膜58で覆われてい 50

【0050】なお、ゲート電極51に印加する電圧はソ ース電極55aに対して正でも負でも良いが、負電圧を 印加する方がセンサの感度が高い。

【0051】本願発明者らの研究によると、基板50が 非ダイヤモンドの場合、アンドープダイヤモンド下地層 52の厚さは1~20μm、p\*層54の厚さは100 A~1μm、半導体ダイヤモンド層53の厚さは100 A~2 μm、ソース・ドレイン電極間距離(以下、これ る。この場合は、下地のアンドーブダイヤモンド膜4110をゲート長と略称する)は $0.5\sim50$   $\mu$   $\mu$   $\mu$   $\mu$   $\mu$ も望ましい。ソース、ドレイン電極の横幅(以下、これ をゲート幅と略称する)は大きいほど信号電流が大きい が、2μmから1mmが最も望ましい。基板50がすべ てダイヤモンド膜の場合には、その厚さは20~500 μπが最も望ましい。

> 【0052】図7はトランジスタがMiSFET (Meta 1-intrinsic Semiconductor-Semiconductor FET)の場 合の例である。半導体ダイヤモンド層53の表面には薄 いアンドーブダイヤモンド膜59が積層されている。

(以下、このアンドーブダイヤモンド膜59をゲート絶 **縁膜という。) 各部分の最も望ましい長さは上記と同じ** である。ゲート絶縁膜59の厚さは100Å~1μmが 望ましい。

【0053】図8はトランジスタがpip-FETの場 合である。このタイプは、半導体ダイヤモンド層53を 有しない。また、ドレイン電極55b側のp<sup>+</sup>層54は 必ずしも必要ではない。各部分の最も望ましい長さは上 記と同様であるが、アンドーブダイヤモンド膜52の厚 さは $1\sim10\mu$ m、ゲート長は $0.5\sim1\mu$ mが最も望 ましい。

【0054】図9はトランジスタがδ-ドープFETの 場合の例である。この場合にはソースとドレイン側のp ・層54が高濃度にBドービングされた薄い半導体ダイ ヤモンド層60で結ばれている。各部分の最も望ましい 長さはpip-FETの場合と同様であるが、薄い半導 体ダイヤモンド層60の厚さは50~500Aが最も望 ましい。

【0055】図6~9においては、識別物質57はゲー ト部に固定されている。しかし、識別物質57をFET の周辺にのみ配置することも可能である。この場合は、 試料中の化学物質・生体物質と識別物質との反応で生じ る副生成物がゲート部の電位を変えるので、これによる FETの電流変化を測定することにより、試料中の化学 物質・生体物質の濃度を知ることができる。

【0056】トランスデューサがサーミスタ型の場合、 試料中の化学物質・生体物質と識別物質との反応で生じ る熱による温度変化を感知することにより、その濃度を 知ることができる。図10、図11はダイヤモンド膜を 用いたサーミスタ型ダイヤモンド・センサの例である。

【0057】即ち、図10に示すように、基板61の上

に、アンドーブダイヤモンド下地層62が形成されてお り、との下地層62の上に、発熱測定用サーミスタ部 と、参照用サーミスタ部とに分かれて、半導体ダイヤモ ンド膜63が形成されている。

【0058】各半導体ダイヤモンド膜63の縁部には、 p\*ダイヤモンド層64が形成されており、各p\*層64 の上には電極65が形成され、これらの電極65は電気 絶縁膜66で被覆されている。電極65間にはアンドー ブダイヤモンド層67が形成されており、一方の発熱測 には、生体関連識別物質68が固定され、この識別物質 68は生体膜69により被覆されている。

【0059】温度が高いほどp型半導体ダイヤモンド膜 63の抵抗値は低くなるので、抵抗値から環境温度を求 めることができる。図10では参照用のサーミスタと発 熱測定用のサーミスタが隣接して配置されており、これ らの温度差から試料中の化学物質・生体物質の濃度を算 定することができる。

【0060】図11では参照用と発熱測定用のサーミス 化できる。

【0061】基板61が非ダイヤモンドの場合、アンド ープダイヤモンド下地層62の厚さは1~20μm、p ・層64の厚さは100人~1μm、半導体ダイヤモン ド層63の厚さは0.5~10μmの範囲か最も望まし い。電極間距離には制限がないが約1 μmから数mmが 可能である。半導体ダイヤモンド膜63が、Bをドープ したp型の場合、ドーピング濃度は1011~1010原子 /cm³が望ましい。

【0062】トランスデューサがホール効果型又は磁気 30 抵抗型の場合、試料中の化学物質・生体物質と識別物質 との反応で磁気的変化が起こる場合に、それを感知して 濃度を知ることができる。

【0063】図12にはホール効果型のセンサの断面図 を示す。また、図13及び図14には電極の配置方法を 示す。但し、電極の位置以外の詳細は省略してある。基 板71の上には、アンドープダイヤモンド層72が形成 され、アンドープダイヤモンド層72の上には、半導体 ダイヤモンド層73が形成されている。そして、この半 導体ダイヤモンド層73の縁部の表面には、p\*ダイヤ モンド層74が形成されており、このp゚ダイヤモンド 層74の上には電極75が形成されている。各電極75 は電気絶縁膜76により被覆されており、電極間にはア ンドープダイヤモンド膜77が形成され、その上に生体 関連識別物質78が固定されている。この識別物質78 が生体膜79により被覆されている。

【0064】基板71が非ダイヤモンドの場合、アンド ープダイヤモンド下地層72の厚さは1~20μm、p ・層74の厚さは100A~1μm、半導体ダイヤモン ド層73の厚さは0.5~50μm、電極間距離は1~ 50

500μmの範囲が最も望ましい。半導体ダイヤモンド 膜73がBをドープしたp型の場合、ドーピング濃度は 1010~1019原子/cm3が最も望ましい。

12

【0065】ダイヤモンド膜にキャリア(電子、正孔) を注入すると短波長の発光か生じる。またダイヤモンド 膜を用いた受光素子も作製できる。そとでダイヤモンド 膜で発光部又は受光部、又はその両方をセンサのトラン スデューサとすることができる。

【0066】例えば、試料中の化学物質・生体物質が識 定用サーミスタ部のアンドーブダイヤモンド層67の上 10 別物質と反応する際に、発光現象が起きれば、それをダ イヤモンド受光素子で検出できる。また、検出しようと する化学物質・生体物質に最も感度が高い波長の光を外 部から照射し、ダイヤモンド受光部で検出することもで きる。さらにダイヤモンド発光部を基坂上に組み込み、 全てをダイヤモンド膜でモノリシックに作製することも 可能である。この光センサ型バイオセンサの一例を図1 5、図16に示す。

【0067】図15に示すセンサにおいては、基板81 の上に、アンドーブダイヤモンド下地膜82が形成され タが一体化されている。これにより作製プロセスを簡単 20 ており、この下地膜82の上に、複数個の第1電極83 及び第2電極84が適長間隔をおいて配置されている。 各電極間は生体関連識別物質85により充填されてお り、この識別物質85は生体膜86により被覆されてい

> 【0068】図16においては、アンドープダイヤモン ド層82の上に、半導体ダイヤモンド層87が形成され

【0069】図15、16においては、識別物質85と 生体物質、化学物質との反応で生じる発光をダイヤモン ド膜82又は半導体ダイヤモンド膜87で感知し、これ **らのダイヤモンド膜中に発生するキャリア(電子、正** 孔)を電極83及び84で測定することにより、生体物 質、化学物質の濃度を検出する。

【0070】基板81が非ダイヤモンドの場合、アンド ープダイヤモンド下地層82の厚さは1~50μm、半 導体ダイヤモンド層87の厚さは0.5~50μm、電 極間距離は1~50μmの範囲が最も望ましい。半導体 ダイヤモンド層87がBをドープしたp型の場合、ドー ピング濃度は10<sup>14</sup>~10<sup>19</sup>原子cm<sup>3</sup>が最も望まし 40 L3.

【0071】これらの各実施例のダイヤモンドバイオセ ンサは、いずれの場合にもトランスデューサ部に光照射 してセンサ感度を増大させることができる。これは光照 射によりダイヤモンド中のキャリア濃度が増加し、信号 強度が増大するからである。

【0072】また、前述のごとく、アンドープの自立性 ダイヤモンド膜をセンサの基板として用いることができ る。この場合、アンドープダイヤモンド膜に成長させた 半導体ダイヤモンド膜の方が、非ダイヤモンド基板に成 長させた半導体ダイヤモンド膜よりも膜質が優れてい

る。基板がすべてダイヤモンド膜の場合には、その厚さ は20~500μmが望ましい。

【0073】前述のごとく、ダイヤモンドには識別物質 の固定が容易である。固定にはダイヤモンド膜表面に識 別物質を直接に塗布することも考えられるが、ダイヤモ ンド膜表面を化学修飾してから、識別物質を固定すると とがより望ましい。又は、ダイヤモンド膜表面を化学修 飾し、さらに長鎖状分子又はメディエータとなる分子 (これらを機能性分子と略称する)と反応させ、これに 識別物質を固定するととも可能である。

【0074】ダイヤモンド膜表面の化学修飾としては、 水素化 (-H)、酸化 (=O、-O=O-、-OH-O H-等)、ハロゲン化 (-C1等) するか、又は水酸基 (-OH)、シアノ基(-CN)、アミノ基(-N H<sub>z</sub>)、カルボキシル基(-COOH)、硫酸基(-S O<sub>1</sub>)、ニトロ基(-NO<sub>2</sub>)で終端化するか、又はこれ らから選ばれた2種類以上の置換基で終端する方法等が 可能である。

【0075】グルコースオキシダーゼのような巨大な識 別物質を固定する場合には、化学修飾されたダイヤモン 20 ングすることにより、識別物質の失活を回避できること ド表面に直接塗布するよりは、上記化学修飾の後、ヘキ サメチレンジアミンなどの長鎖状分子をさらに化学結合 し、しかる後に識別物質を固定する方が望ましい。これ により、ダイヤモンド表面と識別物質の立体障害を避け ることかでき、また長鎖状分子と識別物質が化学結合し てより強い固定が可能になる。長鏡状分子が識別物質と 化学結合するためには、長鎖状分子が水酸基、シアノ 基、アミノ基、カルボキシル基、硫酸基、ニトロ基のう ちの少なくとも1つを含むことか望ましい。長鎖状分子 としてはヘキサメチレンジアミン又はその誘導体が考え 30 生物を用いたセンサである。 **られる。** 

【0076】識別物質とトランスデューサ部との間にメ

ディエータ (電荷移動用分子)層を設ければ、化学物質 ・生体物質と識別物質との反応で生じた電子がトランス デューサ部へ容易に移動でき、センサの感度が向上し、 また溶存酸素等により検出が妨げられることがない。メ ディエータとしてはフェロセン、キノン又はこれらの誘 導体がある。

【0077】但し、通常の金属電極と違って、表面が化 学修飾された半導体ダイヤモンドではこのようなメディ エータがなくとも電子の移動は生じる。

【0078】ダイヤモンド自体は化学薬品に侵されにく 10 いので、たとえセンサが劣化しても識別物質、又は識別 物質及び機能性分子を化学処理により除去し、識別物質 を固定するか、又は機能性分子の合成と識別物質の固定 を行うことにより、センサの再利用が可能である。これ により、有害な廃棄物の処理による環境汚染を防止で き、また、コスト低減にも役立つ。

【0079】測定試料には識別物質を失活させるさまざ まな妨害成分が含まれる場合かある。本発明では、識別 物質の表面にモノレイヤー以上の生体膜物質をコーティ を見い出した。

【0080】生体膜の機能を図17に示す。初期状態で は生体膜はセンサ表面を保護する。検出すべき生体物質 がセンサ表面に吸着されると、生体膜は全体を覆い保護 する。代表的な生体膜物質にはフォスファチジルコリ ン、フォスファチジルセリンなどがある。

[0081]識別物質とそれを検出できる化学物質及び 生体物質を下記表1~4に示す。表1は生体物質、化学 物質検出用センサ、表2は脂質検出用センサ、表4は微

[0082]

【表1】

15 表1 (その1) 生体物質、化学物質検出用センサ

検出物質	識別物質	固定法	電極	安定性(日)	反応 時間 (分)	測定範囲 (mg/l)
<i>∱</i> * <i>№</i> 1-X	<i>ያ* ቤ</i> ጋ-አ <del></del> オキシタ* - サ*	共有結合法	酸素電極	100(10 00回以 上の測 定可)	1/6	1-5×10²
マルトース	グ・ルコアミラーセ	共有結合法	白金電極	_	6–7	10-3-103
カーラクトース	カ <sup>*</sup> ラクトースオキシタ <sup>*</sup> ーセ <sup>*</sup>	吸着法	白金電極	20-40		10-10ª
エタノール	アルコールオキシタ*ー セ*	架橋化法	酸素電極	120	1/2	5-10 <sup>8</sup>
フェノール	チロシナーセ	包括法	白金電極	_	5–10	5-2×10²
カテコール	カテコール1、2-オキシ ケ*ナーセ*	架橋化法	酸素電極	30	1/2	5×10°² -10

表1 (その2)

検出物質	識別物質	固定法	電極	安定性(日)	反応 時間 (分)	測定範囲 (mg/l)
t° ルt° ン酸	t° fit° / 酸  * '  * '  * '  * '  * '  * '  * '  *	吸着法	酸素電極	10	2	10-10³
尿酸	ウリカーセー	架橋化法	酸化電極アンモニアカ・ス電極	120	1/2	10-10ª
L-7ミノ酸	L-73/酸杆沙* -t*	共有結合法	アンモニア カ*ス電極 アンモニウム イオン電極	70	_	5-10²
D-7ミ/酸	D-7ミ/酸井沙* -セ*	包括法	アンモニウム イオン電極	30	1	5-10 <sup>8</sup>
Lーク <sup>*</sup> ルタミン	ク・ルクミナーセ・	吸着法	アンモニウム イオン電極	2	1	10-104

表1 (その3)

検出物質	識別物質	固定法	電極	安定性(日)	反応 時間 (分)	測定範囲 (mg/l)
L-カ <sup>*</sup> ルタミン	<i>ያ* ሕፃ አ</i> ーት ታ* ይት*	吸着法	アンモニウム イオン電極	2	1	10-10 <sup>4</sup>
L-7スパラキ ゚ン	77\\^* 5\ <del>*</del> * <del>}</del> -\te*	包括法	アンモニウム イオン電極	30	1	5-10*
L-チロシン	L-チロシンテ <sup>*</sup> カル本 <sup>*</sup> キシラーセ <sup>*</sup>	吸着法	炭酸がス 電極	20	1-2	10-104
АТР	抗菌性ATPase	ホ*リヒ*ニールフ* チラール ク*ルタルアツテ*ヒ ト*	_	_	_	0.2-1.0 (mM)
アセチルコリン	アセチルコリン レセフ* ター	**リヒ*ニールフ* チラール	_	-	_	0.1-10 (μM)
HSA	抗HSA抗体	** リヒ*ニールフ* チラーセ* ク* <i>ルウルアルテ</i> * ヒ ト*	_	_	_	1.4-14 (μM)

[0083]

\* \*【表2】 **脂質検**出用センサ

検出物質	識別物質	固定法	電極	安定性(日)	反応時間(分)	測定範囲 (電/1)
コレーステロール	コレステロールエステラー セ*	共有結合法	白金電極	30	3	10-500
中性脂質	リハーセー	共有結合法	PH電極	14	4	5-50
りン脂質	<b>ホスホリハ゜ーセ゜</b>	共有結合法	白金電極	30	2	-
モノアミン	モノアミンオキシター	包括法	酸素電極	<7	4	10-100
ペニシリン	ペニシリナーセ゚	包括法	PH電極	7-14	0.5- 2	10×10³

[0084] 【表3]

19 表3(その1)

微生物を用いたパイオセンサ

検出物質	識別物質	固定法	電極	安定性(日)	反応 時間 (分)	測定範囲 (mg/l)
ク・ルユース	Pseudomonas Fluorescence	-	酸素電極	14	10	3-20
資化糖	Brevibacteri um lactoferm entum	_	酸素電極	20	10	20-200
酢酸	Trichosporon brassicae		酸素電極	30	15	10-200
アンモニア	硝化菌	_	酸素電極	20	5	3-45
メタノール	未同定菌	_	酸素電極	30	15	3-22
エタノール	Trichosporon brassicae	_	酸素電極	30	15	3-30

表3(その2)

検出物質	識別物質	固定法	電極	安定性(日)	反応 時間 (分)	測定範囲 (mg/l)
ナイスチタン	Saccharomyce s cerevisiae	_	酸化電極	-	60	1. 2-800
変異原	Bacillus subtilis	-	酸素電極	-	60	1-10
亜硝酸塩	Nitrobacter sp	_	酸素電極	24	4	51-250
ピタミン812	Escherichia coli	_	酸素電極	25	2	5×10 <sup>-3</sup> -2.5× 10 <sup>-2</sup>
メタン	Methyromonas flagellata	_	酸素電極	30	0.5	0. 2–100
BOD	Trichosporon cutaneum	-	酸菜電極	30	10	3-30

22

表3 (その3)

検出物質	識別物質	固定法	電極	安定性(日)	反応 時間 (分)	測定範囲 (mg/l)
L* <b>タミンB1</b>	Lactobacillu s fermenti	_	燃料電池	60	360	10 <sup>-3</sup> -10 <sup>-3</sup>
<b>‡*酸</b>	Clostridium botyricum	-	燃料電池	30	10	1-1000
セファロス木*リ ン	Citrobacter freundii	-	pH電池	7	10	60-500
ニコチン酸	Lactobacillu s arabinosus	-	pH電池	30	60	10-3-5
グルクミン酸	Escherichia coli	-	CO <sub>2</sub> 電池	20	5	8-800
リシン	Escherichia coli	_	CO <sub>2</sub> 電池	20	5	10–100

【0085】ところで、通常のダイオード型のバイオセ ンサの電極間の電位差は±5 V以内、多くは±1 V以内 に設定されている。シリコン半導体を用いた ISFET では通常、±5 V以上の電圧を印加するとFETが破壊 される。しかし、ダイヤモンドは耐電圧性に優れてお り、ダイオード型でもトランジスタ型でも、±5 V以上 30 った高配向膜又はヘテロエピタキシャル膜を形成しても の電圧に十分耐えられる。特に、S/N比の高い高感度 の測定には、センサの電圧を上げざるを得ないが、本発 明によるダイヤモンド・バイオセンサは±10V以上の 電圧で問題なく駆動できる。本発明者らの研究ではダイ ヤモンドバイオセンサの駆動電圧は最大±50V、望ま しくは±5~±20Vである。

【0086】以上、単一の機能をもつトランスデューサ がダイヤモンド薄膜で製作されている場合について説明 した。しかし、本発明により、同一基坂上に同一又は異 なる機能をもつ複数のセンサを配置することもできる。 例えば、ダイオード型センサについていえば、同一基板 上に同種類の識別物質が固定された複数のセンサを設け ることにより、信頼性を高めることができる。

【0087】また、固定する識別物質を変えれば、1つ のセンサで複数の化学物質・生体物質を同時に感知・定 量できる。これは、においセンサ、味覚センサ及び鮮度 センサのように、複数の成分を測定する場合には特に有 効である。また、ダイオード型のセンサに温度センサ又 はpHセンサを併置すれば、リアルタイムでセンサ感度 の温度補正又はpH補正ができる。

【0088】上記のダイヤモンド膜としては、天然又は 人工合成のバルク・ダイヤモンド結晶を基板として、そ の表面にダイヤモンド膜を気相合成してもよいし、シリ コン、窒化シリコン、炭化シリコン、高融点金属等の非 ダイヤモンド基板に、通常の多結晶膜、粒子配向のそろ よい。

【0089】ダイヤモンド膜の結晶面により、化学反応 性及び表面構造が異なるので、化学装飾、機能性分子の 結合には表面を選ぶ必要がある。本発明ではダイヤモン ド膜の表面の一部又は全部が(111)結晶面又は(1 00)結晶面から構成されている場合に、電流-電圧特 性の直線性及びS/Nの優れたセンサができることを見 出した。

【0090】次に、本発明の実施例に係るバイオセンサ 40 を実際に製造し、その特性を調べた結果について説明す

## [実施例1] ダイオード型センサ

#### (1A) ダイヤモンド素子作製

1 c m角の窒化シリコン基板をダイヤモンド粉末でバフ 研磨し、マイクロ波CVD装置により、メタン1~5 %、酸素 0. 1~2%を水素希釈したもの(全流量 10 0sccm)を原料ガスとして20時間合成を行い、膜 厚10μmのアンドーブダイヤモンド膜を形成した。C VDにおいては基板温度を800~850℃、ガス圧を 50 30~60 Torrの範囲で一定に保った。

【0091】次いで、作用電極として、選択成長技術を 用いて、幅10μm、長さ2mm、膜厚2μmのBドー プしたp型半導体ダイヤモンド膜を20μmピッチで1 0本、との基坂上に形成した。 合成には同じくマイクロ 波CVDを用い、メタン1~5%、酸素0~2%、ジボ ラン(BスH。)0.1~20ppmを水素希釈したもの (全流量100gccm) を原料ガスとした。合成時間 は10時間であった。

23

【0092】次いで、対向電極として、フォトリソグラ フィ技術により幅20μm、長さ2mm膜厚1000Å 10 の白金膜を形成した。

#### (1B) 識別物質の固定化

この素子を髙周波プラズマ装置に入れ、酸素ガス0.1 Torrで10分間、表面処理を行い、ダイヤモンド表 面を酸化した。更にこれをヘキサメチレンジアミンに浸 し、50℃~90℃で10時間保持し、ダイヤモンド表 面の長鎖分子を化学結合させた。

【0093】次いで、この素子をpH7の10%グルタ ルアルデヒド、O. 1 M燐酸バッファニ溶液に浸し、室 温で2時間保持してからバッファー溶液で洗浄した。

【0094】グルコースオキシダーゼを固定化するため に、作用電極以外の電極をフォトレジスト膜でマスク し、1%グルコースオキシダーゼを懸濁させた燐酸バッ ファー溶液に素子を一昼夜放置した。最後に、バッファ -溶液で素子を洗浄し、有機溶媒でフォトレジスト膜を 除去した。

### (1C) 識別物質の保護

pH7の0.1M燐酸パッファー溶液と生体膜物質であ るフォスファチジルコリンを混合し、超音波処理により 懸濁させた。との溶液に、上記のグルコースオキシダー 30 ゼを固定化した素子を一昼夜浸した。

#### (1D) センサ特性の評価

上記のように作製したダイオード型のダイヤモンドセン サをグルコースを含む0.1Mの塩化ナトリウム溶液に 浸し、作用電極と対向電極及び参照電極と対向電極間に 1 V を印加し、グルース濃度を変えて電流測定を行っ た。得られたデータを、図18において、曲線Aにて示 す。

【0095】ととでは、電流は、作用電極-対向電極及 び参照電極-対向電極間の電流値の差である。グルコー ス濃度50mg/リットルから600mg/リットルで電流値は ほぼ直線上にプロットされた。

# (1E) 光照射の効果

センサに水銀ランプを照射して、10と同様の測定を行 った。この結果を図18において、曲線Bに示す。グル コース濃度50mg/リットルから600mg/リットルで電流 値は2~3μΑ増大した。

## (1F) 再生したセンサの特性

センサをバッファ溶液中で超音波処理してグルコースオ キシダーゼを除去し、上記1B以下の酸素プラズマ処理 50 サ、鮮度センサなどとしても利用でき、医療、食品管

を除くプロセスで、センサを再生した。次いで、上記1 Dと同様に、このセンサの特性評価を行った。この結果 を図18において曲線Cにて示した。電流値は再生前と ほぼ同一であった。

74

#### (1G) 生体膜の効果

図19にはセンサに生体膜をコーティングした場合(曲 線A)と、しない場合(曲線B)を示した。生体膜をコ ーティングした場合(曲線A)は1000回の繰り返し 使用で電流値は約10%低下したのに対し、コーティン グのない場合(曲線B)には約500回で電流値が約1 0%低下した。この結果、センサ表面に生体膜をコーテ ィングすることにより、寿命が約2倍に増大することが 分かった。

[実施例2]マイクロアレイ型センサ

実施例1と同様の方法で、マイクロアレイ型センサを作 製した。作用電極の半導体ダイヤモンド膜のアクティブ な領域の幅は10μm、長さは300μm、電極間のア ンドープ・ダイヤモンド膜の幅は10μmとし、これを 50本、基坂上に並列させた。公知の方法を用いて、ア ンドープ・ダイヤモンド膜表面にのみグルコースオキシ ダーゼを固定化し、その表面に生体膜をコーティングし

【0096】実施例1の工程1Dと同様に、特性を評価 したところ、電流値はほぼ電極面積に比例することが分 かった。

### [実施例3]トランジスタ型センサ

文献K.Nishimura et al.,Advances in New Diamond Sci ence and Technology, edited by S.Saito et al (MYU, T okyo 1994)p.725に記載されたものと同様に、単結晶ダ イヤモンド基板上にソース・ドレイン電極間距離 1 0 μ m、ゲート幅500μmのMiS型FETを2素子、並 列して作製した。

【0097】との一方の素子にのみ実施例1の工程1日 及び1Cと同様の方法でグルコースオキシダーゼを固定 化した。他方の素子は参照用として用いた。

[0098] 測定用素子及び参照用素子の各ソース・ド レイン電極間に10μΑ電流が流れる場合に、この2素 子についてソース・ドレイン間電圧の差を出力電圧とす る回路を作製し、グルコース濃度を変えて出力電圧を測 定した。との結果を図20に示す。

### [0099]

【発明の効果】本発明によれば、ダイヤモンド膜に生体 関連識別物質を固定したので、種々の化学物質及び生体 物質に対し、高感度及び高速応答性で応答するバイオセ ンサを得ることができる。

【0100】また、トランスデューサ及び周辺回路を半 導体ダイヤモンド膜を用いて作製することにより、化学 センサ及びバイオセンサの実用化が容易となる。

【0101】更に、本発明は、においセンサ、味覚セン

理、工業プロセス、環境モニタ等の技術分野において、 多大の貢献をなす。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例に係るダイオード型ダイヤモン ドセンサを示す断面図である。

[図2] 本発明の実施例に係るマイクロアレイ型ダイヤ モンドセンサを示す断面図である。

【図3】本発明の実施例に係るマイクロアレイ型ダイヤ モンドセンサを示す断面図である。

【図4】本発明の実施例に係るマイクロアレイ型ダイヤ 10 モンドセンサを示す断面図である。

【図5】本発明の実施例に係るマイクロアレイ型ダイヤ モンドセンサを示す断面図である。

【図6】本発明の実施例に係るトランジスタ型ダイヤモ ンドセンサを示す断面図である。

【図7】本発明の実施例に係るトランジスタ型ダイヤモ ンドセンサを示す断面図である。

【図8】本発明の実施例に係るトランジスタ型ダイヤモ ンドセンサを示す断面図である。

【図9】本発明の実施例に係るトランジスタ型ダイヤモ 20 32、42:参照電極 ンドセンサを示す断面図である。

【図10]本発明の実施例に係るサーミスタ型ダイヤモ ンドセンサを示す断面図である。

【図11】本発明の実施例に係るサーミスタ型ダイヤモ ンドセンサを示す断面図である。

【図12】本発明の実施例に係るホール効果型ダイヤモ ンドセンサを示す断面図である。

【図13】同じくその電極配置を示す平面図である。

【図14】同じくその電極配置を示す平面図である。

【図15】本発明の実施例に係る光センサ型ダイヤモン 30 53、63、73、87:半導体ダイヤモンド膜 ドセンサを示す断面図である。

【図16】本発明の実施例に係る光センサ型ダイヤモン ドセンサを示す断面図である。

【図17】生体膜の機能を示す模式図である。

【図18】ダイオード型センサの特性を示すグラフ図で ある。

\*【図19】生体膜の効果を示すグラフ図である。

【図20】トランジスタ型センサの出力電圧を示すグラ フ図である。

26

【図21】生体関連識別物質とダイヤモンドバイオセン サとの関係を示す模式図である。

【図22】従来のトランジスタ型センサを示す図であ る。

【図23】従来のダイオード型センサを示す図である。

【図24】従来のマイクロアレイ型センサを示す図であ

【図25】従来のISFETを使用したグルコースセン サを示す図である。

【図26】従来のサーミスタ型センサを示す図である。

【図27】従来のヒータ内蔵型バイオセンサを示す図で ある。

#### 【符号の説明】

30、40、50、61、71、81:基板

31、41、52、62、72、82:アンドープダイ ヤモンド下地膜

33、43:対向電極

34、44:作用電極

35、45、57、68、78、85:生体関連識別物

36、46、58、69、79、86:生体膜

37:半導体ダイヤモンドヒータ

38、47、59、67、77:アンドープダイヤモン ド膜

51:ゲート電極

54、60、64、74:p'層

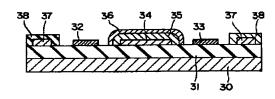
55a、55b、65、75:電極

56、66、76:電気絶縁膜

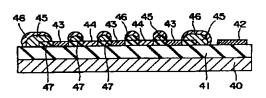
83:第1電極

84:第2電極

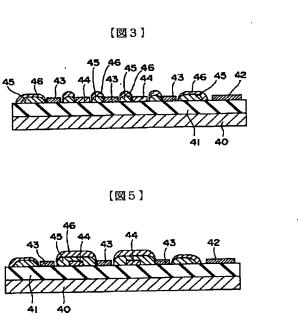
【図1】

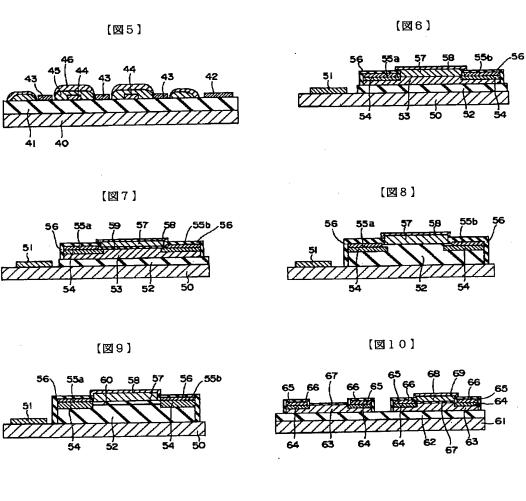


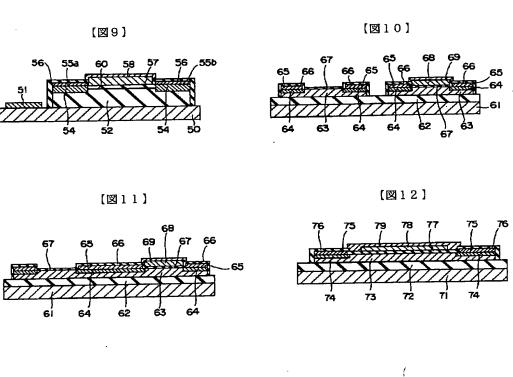
【図2】

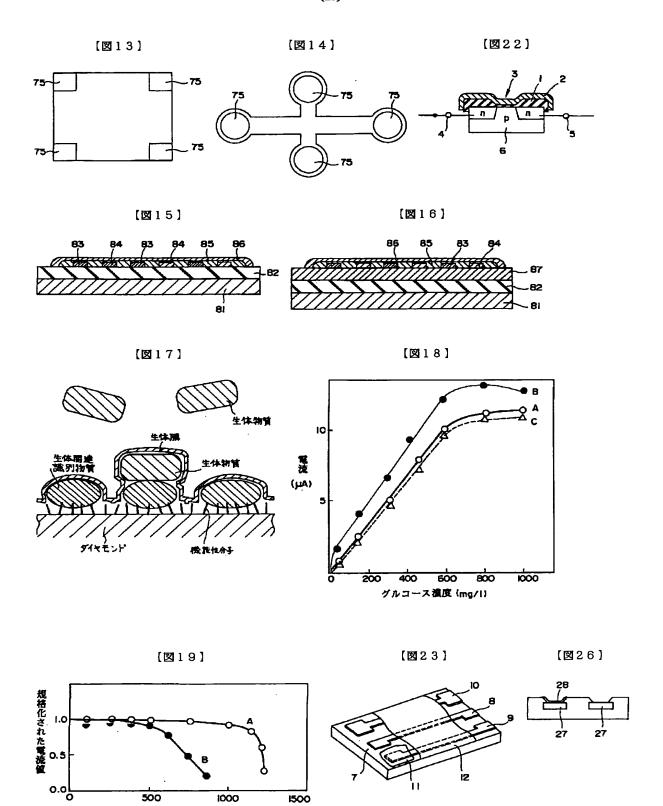


【図4】

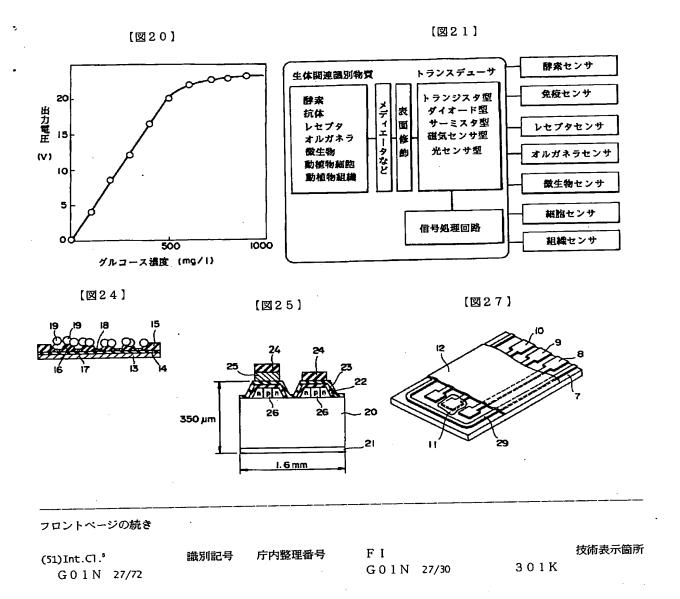








測定回数 (回)



inis Page Blank (uspio)